



mesa
electronic

3.03.2

檢露儀 1.1 與 2.1

本露點量測儀器-檢露儀1.1與檢露儀2.1為量測氣體露點的攜帶型設備。根據定義，露點為水氣開始結露的溫度，此時結露與蒸發達平衡。

在這兩樣設備中的量測方式，是利用冷卻使鏡面降溫，讓結露可見。

因此，此量測具有長期穩定性，並且僅需很少的維護。

本設備的應用範圍是氣體、變成爐及熱處理設備的露點量測。

檢露儀2.1較檢露儀1.1多配備了一個線上傳感器，因此可用於連續量測。量測結果可以經由泛用類比輸出或是數位的RS-485 / RS-422介面傳送。藉由調整鏡子的溫度，量測結果相較於其他類似設備非常準確。檢露儀1.1與2.1均可指定選用230V或115V其中一種的電源供應。

本設備具有下列優越的特性：

- 容易使用
- 高量測穩定度
- 高量測精確度
- 對於含有塵埃與具腐蝕性的氣體不敏感
- 構造堅固

量測功能描述：

- 量測範圍廣
鏡面：-25°C...+20°C
感知器：-80°C...+20°C
- 藉由維持溫度、以及每段±0.2°C 微調的方式確認露點
- 精度 0.1°C

標準輸出輸入：

- 內建氣體取樣幫浦
- 氣體入口及出口為軟管接頭
- 數位輸出 RS-485 Modbus 通訊協定

6 技術資料

構造	攜帶式鐵殼型
尺寸(WxHxD) mm	330x310x320
重量	約17 kg
環境溫度	操作時 10~40 °C · 存放時 0~50 °C
供應電壓	230 或 115 VAC ±10% · 50~60 Hz (請於訂購時指定)
量測氣體接頭 (軟管接頭)	入口：管內徑 5~6 mm 出口：管外徑 5~6 mm
量測氣體壓力	±50 mbar
量測範圍：	
檢露儀 1.1 及 2.1：	-25...+20 °C (以鏡面直接量測)
檢露儀 2.1：	-80...+20 °C (以電容式傳感器間接量測)
精度	±0.5 °C (以鏡面直接量測) ±2 °C (以電容式傳感器間接量測)
解析度	0.1 °C
維護間隔	每年
類比輸出 (僅適用檢露儀 2.1)	-80~ +20 °C · 0~20 mA 或 4~20 mA 或 0~10 V 電隔離 · 預設為 4~20 mA
腳位	電流輸出：Pin 6 · GND = Pin 2 電壓輸出：Pin 7 · GND = Pin 3
數位輸出 (僅適用檢露儀 2.1)	四線RS-485 / RS-422 或二線RS-485 (請於訂購時指定)
腳位	Modbus通訊協定隔離介面 四線：GND = Pin 1 · TxA = 9 · TxB = 5 · RxA = 8 · RxB = 4 二線：GND = Pin 1 · A = 9 · B = 5

7 配件

零件名稱	訂購編號
檢露儀 1.1 燒結過濾器：(15 µm)	24180
檢露儀 2.1 燒結過濾器：(7 µm)	24181
2A 保險絲	027-0005
4A 保險絲	027-0011
風扇過濾片	24202
在線過濾器附接頭	24382